



# 超並列電子線描画装置

(A Kojima, H. Ohyi and N. Koshida (クレステック、東京農工大), J. Vac. Sci. Technol., B26, 6 (2008) 2064)

1. はじめに

2. MEMSセンサ

3. 健康・安全のためのMEMS

4. 集積化MEMS

5. オープンコラボレーション

(乗合ウェハ、試作コインランドリ、人材育成 他)

